

Munkabeosztás a Quanta 3D SEM/FIB eszközön. 2012. október 22 – október 28.									
	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat	Vasárnap		
7									
8	Munkaszüneti nap	Munkaszüneti nap	Lendvai János Mohammed Ezz. csavarással deformált amorf minta FIB, ETD VG, BA	Jirka Navrkal Mikroszkóp elektron- és ion paramétereinek beállítása BA, VG	Berecz Tibor Fe minta EBSD mérése VG, DZ				
9									
10									
11									
12					Kalácska Szilvia (SzA) EBSD próbamérések FIB megmunkálás után (Fe minta) VG, BA	EBSD gyakorlatok egykristály mérése DZ, HK	Technoorg EBSD mérések Ni mintán VG, DZ		
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									

Megjegyzések

DZ

HK

VG

BA

KSz

SzA

Dankházi Zoltán

Havancsák Károly

Varga Gábor

Baris Adrienn

Kalácska Szilvia

Székely Anna